

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| タイトル | 発明者 | | | | |
| 面法線計測方法及びその装置 | 工学部 福祉人間工学科 メカトロニクス研究室 岡田 徳次 | | | | |
| 分野 | <input checked="" type="checkbox"/> IT | <input type="checkbox"/> ナノ | <input type="checkbox"/> バイオ | <input type="checkbox"/> 環境・エネルギー | <input type="checkbox"/> その他 |

概要

離れた位置にある対象物表面の法線を計測する方法及び装置を提供する。

両端面を平行に組み合わせた2枚のウェッジプリズム11a、11bを格納する円筒状の光学系1を構成し、これを一体として角度可変アクチュエータ41により回転させ、投光器31から発射する光の照射位置を可変とし、照射体の少なくとも3点94a、94b、94cに光ビームを照射して得られる距離データを基に法線演算回路51で法線を算出することにより、離れた位置にある対象面の面法線を計測する方法及びその装置を提供する。

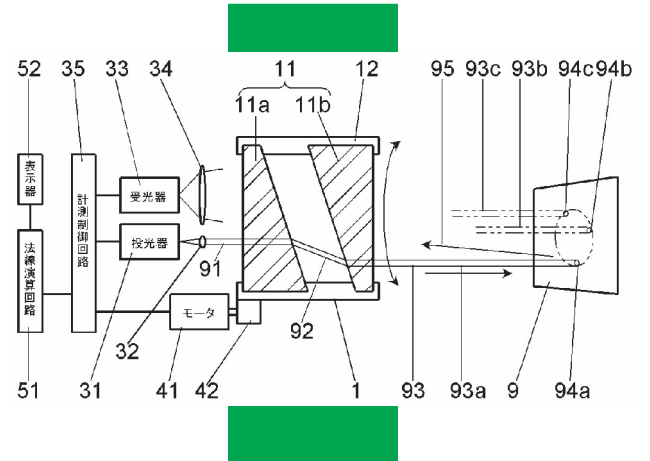


図. 面法線計測原理の説明

社会還元の可能性と応用分野

